

Изобретение относится к инженерной геодезии. Способ контроля высотных отметок деформационных марок основывается на фотоэлектрической регистрации относительного положения трех соседних марок. При этом фотоэлектрический измерительный прибор (ФЭП) соединяют с посадочной конструкцией деформационной марки, световые излучатели соединяют также с соседними с обеих сторон от ФЭП деформационными марками, а световые потоки от световых излучателей направляют в объектив ФЭП и измеряют разность угловых отклонений изображений световых излучателей в поле зрения ФЭП, потом ФЭП переставляют на соседнюю марку по направлению нивелирного хода, а световые излучатели переставляют также на соседние по ходу марки и выполняют измерение, аналогичное предыдущему. Далее повторяют описанные операции по всему нивелирному ходу, а по полученным разностям угловых отклонений изображений световых излучателей на всех деформационных марках, включая марки на опорных реперах, рассчитывают и уравнивают значение высотных отметок деформационных марок и сравнивают эти значения с полученными в предыдущем очередном цикле значениями измерений. Техническим результатом являются сокращения ручных операций за счет исключения визуальных измерений, что дает возможность получить существенный технико-экономический эффект.